

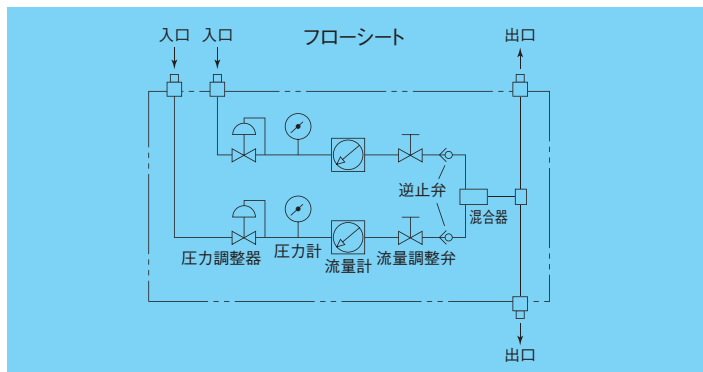
**F** ガス混合器/大型ガス混合装置  
① 小型ガス混合器

2MD-100型…適用ガス

<b>Ar</b> アルゴン	<b>CO<sub>2</sub></b> 二酸化炭素	<b>Air</b> 空気	<b>N<sub>2</sub></b> 窒素	<b>He</b> ヘリウム	<b>H<sub>2</sub></b> 水素
-------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------

【概要】

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び精度の高い混合精度のミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることが出来る、小型ガス混合装置です。又本装置は他社にない数々の特長をおり込んで製品化し、好みのガス混合比率を簡単に作り出す事ができます。



【特長】

- \*ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は、±2～5%です。
- \*独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は、±2～5%です。
- \*小型、軽量で持ち運びが、簡単です。
- \*出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。
- \*混合ガス流量は、最大100ℓ/min。(標準状態)
- \*逆止弁付

【仕様】

混合ガス	Ar,CO <sub>2</sub> ,Air,N <sub>2</sub> ,He,H <sub>2</sub> 等	入口形状	9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所)		
入口圧力	0.4～1.0MPa	出口形状	9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所、内1ヶ所盲)		
調整圧力	0.3MPa(調整器でセットして下さい。)	寸法	幅300×高さ180×奥行160mm		
混合精度	±2～5%	質量	7kg		
混合流量	MAX.100ℓ/min(標準状態) *これ以上は特注品で対応します。	【ご注文方法】 次の事項をお知らせ下さい。			
流量計目盛	50+50ℓ/min(標準状態)			1.使用目的/用途	4.混合比
	30+30ℓ/min(標準状態)			2.ガスの種類	5.入口圧力
	15+15ℓ/min(標準状態) *その他の組み合わせは、指示下さい。	3.混合ガス流量	6.出入口形状		

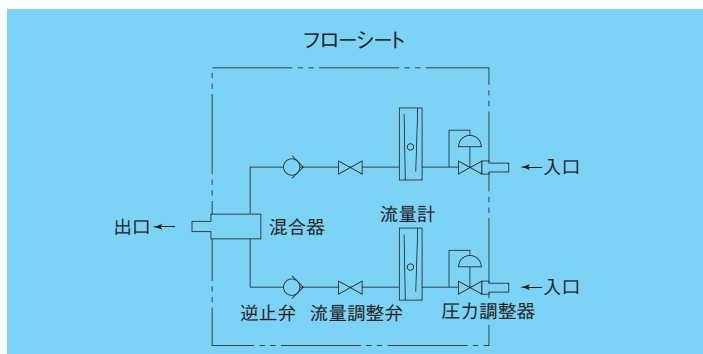
●特殊ガスの場合は、調整器タイプ、部品・配管材質等 が変わる可能性がありますので、ご相談ください。

2MF-100型…適用ガス

<b>Ar</b> アルゴン	<b>CO<sub>2</sub></b> 二酸化炭素	<b>N<sub>2</sub></b> 窒素	<b>O<sub>2</sub></b> 酸素
-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

【概要】

本装置は1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。



【特長】

- \*フロート式流量計の使用によりガス流量精度は、±2～5%です。
- \*独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は、±2～5%です。
- \*調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。
- \*小型、軽量で持ち運びが、簡単です。
- \*逆止弁付。

【仕様】

適合ガス	Ar+CO <sub>2</sub> 専用	入口形状	9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(2ヶ所)
入口圧力	0.4～1.0MPa	出口形状	9/16-18UNFオネジ、1/4ホース口付(1ヶ所)
調整圧力	0.3MPaに固定	寸法	幅200×高さ220×奥行230mm
混合精度	±2～5%	質量	6kg
最大流量	Ar,CO <sub>2</sub> 共 50ℓ/min(標準状態)	(備考) Ar+H <sub>2</sub> 等、他のガスにもオプションで対応いたします。	
流量計目盛	Ar/CO <sub>2</sub> =25ℓ/min/25ℓ/min(標準状態)		
	Ar/CO <sub>2</sub> =50ℓ/min/50ℓ/min(標準状態)		

I 一般工業ガス用  
圧力調整器

II 分析用標準ガス・  
理科学機器用  
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス・  
高純度・超高純度  
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス  
供給設備・機器

V 分析用標準ガス  
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス  
高純度・超高純度  
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料